04;11;12

Динамика пятен на медном катоде в сильноточной вакуумной дуге

© А.А. Логачев, А.М. Чалый, С.М. Школьник

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия)

(Поступило в Редакцию 27 марта 1996 г.)

1. Сильноточной вакуумной дугой (СВД) будем называть дуговой разряд в вакууме с током $I \gg I_{\rm n}$, т. е. разряд, в котором на катоде одновременно горит много катодных пятен (КП), $I_{\rm n} \sim 10^2$ А — ток, пропускаемый одним КП. Исследования СВД кроме физического интереса стимулируются необходимостью совершенствования вакуумной коммутационной аппаратуры, которая все шире используется в технике и вытесняет масляные выключатели, воздушные дугогасительные камеры и т.д. [1].

Существенное отличие вакуумной дуги от дуги в газовой атмосфере состоит в том, что плазмообразующим веществом являются только продукты эрозии электродов. Основным источником вещества в режимах с диффузной привязкой дуги к аноду являются КП, из которых в межэлектродный промежуток истекают сверхзвуковые струи плотной сильноионизованной плазмы [2,3]. В связи с этим очевиден интерес к изучению динамики КП как в процессе развития дуги после поджига [4], так и в последующих фазах ее горения [5].

2. Известно, что после токовой тренировки (очистки поверхности) на однородных металлических катодах быстро перемещающиеся малоэрозионные КП исчезают, заменяются малоподвижными с большой эрозией. Такие КП после поджига разряда образуют на катоде кольцо, радиус которой r растет со временем. Как внутри, так и снаружи кольца могут появляться лишь случайные пятна [6,7]. Зависимость r = r(t) хорошо воспроизводится от разряда к разряду и определяется формой импульса тока I = I(t). Неоднократно высказывалось предположение, что расширение кольца в СВД есть ретроградное движение КП (движение в направлении, противоположном амперовой силе, действующей на ток, протекающий через пятно) в собственном магнитном поле разрядного тока, подчиняющееся тому же закону, что и движение одиночного пятна в слаботочной ($I \sim I_{II}$) дуге во внешнем магнитной поле, параллельном плоскости катода, а именно $V = K \cdot B$, где V — скорость ретроградного движения КП; В — индукция внешнего магнитного поля; К — коэффициент, определяемый материалом катода и не зависящий от B ($B \leq 0.12$ [8], 0.2 Тл [9]). По данным [8], К зависит не только от материала, но и от тока и межэлектродного промежутка h.

Для СВД, в которой одинаковые пятна симметрично расположены на кольце радиуса *r*, с учетом этого предположения получим

$$dr/dt = K \cdot B(t), \tag{1}$$

где $B(t) \approx \mu_0 I(t) 4\pi r(t)$ — индукция магнитного поля, создаваемого током, протекающим через остальные пятна в месте расположения произвольно взятого пятна.

Для импульса тока прямоугольной формы с передним фронтом длительностью *t*₀ из (2) следует

$$r^{2}(t) = \frac{K\mu_{0}I}{2\pi}(t-t_{0}) + r_{0}^{2}.$$
 (2)

Здесь через x_0 обозначен радиус кольца пятен при $t = t_0$. Экспериментальные исследования динамики КП в СВД ограничены, а результаты их противоречивы. Впервые зависимость радиуса кольца КП от времении тока на катодах из различных металлов была измерена в [10]. Использовался прямоугольный импульс тока длительностью 2 мс с передним фронтом ≈ 0.5 мс. Получено, что $r \sim t^{\alpha} \cdot I^{1/2}$. При I < 1.5 кА $\alpha = 1/2$ в соответствии с (2). Для медного катода из данных [10] можно получить $K \approx 50$ м/(с·Тл) независимо от тока. Однако при I > 1.5 кА $\alpha = 0.8-1.0$. Обнаружена слабая зависимость от h при h < 5 мм. Поэднее в [6] были измерены мгновенная скорость расширения кольца КП $V_{\rm x}(t)$ и с помощью магнитного зонда соответствующая ей индукция собственного магнитного поля B(t) в СВД с медными электродами при токе 2.7 < I < 6.9 кА, $10 \leq h \leq 30$ мм. В полном соответствии с (2) V_k оказалась прямо пропорциональной В. Вне зависимости от I и h получено K = 700 м/(с·Тл). Однако такая закономерность сохранялась лишь для B < 0.02 Тл (большие r). При B > 0.02 Тл пропорциональность нарушалась и, по мнению авторов, появлялась тенденция к насыщению скорости (см. рис. 3 в [6]). Такая трактовка представляется неоднозначной, так как на рис. 3 в [6] приведено слишком мало экспериментальных точек, относящихся к В > 0.04 Тл. Нельзя исключить, что кривая $V_k = V_k(B)$ имеет два примерно линейных участка (при B < 0.02 и B > 0.04 Тл) с сильно различающимися наклонами: $K \sim 10^2$ м/(с·Тл) при B > 0.04 Тл (малые r).

В недавней работе [4] показано, что на чистой поверхности ряда металлов при $h \approx 3-5$ мм, 1 < I < 10 кА и $B \leq 0.4$ Тл соотношение (1) выполняется и, в частности, для меди K = 220 м/(с·Тл) независимо от тока. По мнению авторов [4], как большое значение K (при больших r), полученное в [6], так и более сильная, чем это следует из (2), зависимость r от времени, полученная в [10] при больших токах, есть результат плохой очистки периферии катода в этих работах. Однако в [4] не прослежена зависимость от межэлектродного

промежутка. Кроме того, часть анода была закрыта сеткой с достаточно высокой прозрачностью, через которую проводилось фотографирование катода.

Целью настоящей работы являлось проведение систематических экспериментальных исследований динамики КП на медном катоде в зависимости от тока и межэлектродного промежутка. Некоторые предварительные результаты работы были опубликованы ранее [11].

3. Эксперименты проводились в разборной вакуумной камере при непрерывной откачке паромасляным насосом, снабженным ловушкой, охлаждаемой жидким азотом. Остаточное давление $p < 10^{-5}$ мм рт. ст. Использовались плоские торцевые электроды диаметром D = 2R = 30 мм из бескислородной меди. В специальной серии экспериментов торцевой анод заменялся анодом из молибденовой сетки: проволока диаметром 0.4 мм, шаг 2.5 мм. Сетка приваривалась на торец цилиндра из нержавеющей стали с внешним диаметром 32 мм, внутренним — 28 мм. Межэлектродный промежуток $0.5 \le h \le 8$ мм.

В центре катодов были просверлены отверстия диаметром 2.5 мм. Разряд поджигался внутри отверствия вблизи поверхности электрода обрывом тока (≈ 10 A) во вспомогательной цепи. Разряд питался от емкости $C \approx 2$ Ф, $U \approx 120$ В, подключаемой транзисторным ключом на время $0.5 \leq \tau \leq 5$ мс. Ток регулировался в пределах $0.5 \leq I \leq 5$ кА малоиндуктивным балластным сопротивлением. Импульсы тока даже при максимальных I и τ были практически прямоугольной формы. Передний фронт при максимальном токе не превышал 150 мкс. Паразитное магнитное поле токоподвода было подавлено, так что индукция внешнего магнитного поля в межэлектродном промежутке не превышала 0.5 мТл.

Ток и напряжение разряда измерялись осциллографами С9-8. Процессы на катоде фиксировались камерой для высокоскоростной фотосъемки ВФУ-1 (10– 25 мкс/кадр). Камера располагалась под небольшим углом к электроду. Электроды тренировались серией ~ 20 импульсов тока $I \approx 5$ кА, $\tau \approx 5$ мс. Непосредственно перед фотографированием давались 2–3 тренировочных импульса.

4. Результаты экспериментов обрабатывались следующим образом. Строились кривые $r^2(t)$, которые имеют, как видно из рис. 1, а, два характерных участка. Первый — нелинейный, наиболее отчетливо выраженный при большом токе. Его длительность коррелирует с длительностью переднего фронта импульса тока, определяемой по осциллограммам. Второй (при $I \approx \text{const}$) хорошо аппроксимируется линейной зависимостью $r^2(t) = P_1 \cdot t + P_2$. В некоторых случаях при $r \sim R$ линейность нарушалась. Это объясняется недостаточной очисткой периферии катода. Такие результаты браковались и катод дополнительно тренировался. Параметры *P*₁ и *P*₂ определялись по методу наименьших квадратов. Попытки определить нелинейные члены (степеней 2, 3, 4) дали значения неотличимые от нуля (оценка погрешности этих членов в несколько раз больше их величины). Это показывает, что предположение относительно динамики КП в СВД, при которых получено выражение (2), дающее линейную зависимость квадрата радиуса кольца КП от времени на плато импульса тока, действительно справедливо.

Коэффициент K определялся для каждого режима в результате усреднения по 6–8 измерениям (рис. 1, δ). По-грешность определялась из разброса экспериментальных результатов.

5. Результаты обработки измерений приведены на рис. 2. Видно, что коэффициент К зависит от межэлектродного промежутка (рис. 2, *a*). Зависимость K = K(h)в СВД ранее исследовалась в [10], однако приведенные в этой работе данные недостаточны, чтобы провести количественное сравнение. Результаты настоящих измерений можно сопоставить с измерениями в слаботочных дугах, например [8]. Сопоставление представляется разумным, так как в [8] исследования проводились во внешнем поле $B \leq 0.12$ Тл. В наших экспериментах индукция собственного магнитного поля тока уменьшается до такого значения практически сразу после прохождения переднего фронта импульса тока. Сравнение результатов, приведенных на рис. 2, a и на рис. 5 работы [8], показывает сходный характер зависимости K = K(h) при $h \leqslant 3$ мм. Однако в слаботочной дуге при h > 3 мм $K \approx \text{const}$, а в СВД кривая K = K(h) удовлетворительно аппроксимируется логарифмической зависимостью.

Как следует из рис. 2, δ , при $h \ge 1$ мм коэффициент К слабо растет с ростом разрядного тока. Это противоречит результатам, полученным ранее в СВД [4,6,10]. Причиной расхождения с [10] является некорректная процедура обработки, использованная в этой работе, не учитывающая достаточно длинный передний фронт импульса. Действительно, как показали проделанные нами вычисления, если кривые $r^2(t)$ аппроксимировать прямой, включая начальный участок, то результаты будут зависеть от длины обрабатываемого участка, и если длительности линейного (I = const) и нелинейного (на фронте тока) участков сравнимы по величине, то значение К получается заниженным, а зависимость от тока пропадает. Естественно, такая обработка некорректна как с математической (значение критерия χ^2 в несколько раз больше, чем при обработке только линейного участка), так и с физической точки зрения. Что касается работы [6], то вопреки утверждению ее авторов полученные результаты (см. рис. 3 в [6]) фактически не позволяют проследить зависимость K = K(I). Причины расхождения с результатами работы [4] неясны. Так, в ней использован импульс с коротким передним фронтом 20 мкс. В слаботочной дуге наблюдалась зависимость К от тока, причем более сильная, чем в настоящем эксперименте. При h = 15 мм изменение тока от 30 до 60 А приводило к увеличению К в 2.5 раза [8].

На рис. 2, б приведены также результаты, полученные в СВД с анодом из Мо сетки (материал, из которого изготовлена сетка, не будет влиять на динамику КП, так как еще в процессе токовой тренировки сетка запыляется



Рис. 1. Зависимости квадрата радиуса кольца катодных пятен от времени. a — измеренные зависимости $r^2 = r^2(t)$ и аппроксимации линейного участка, δ — семейства аппроксимирующих прямых; h = 4 мм; $I \approx 4.6$ (1), 2.8 (2), 1.6 кА (3).



Рис. 2. a — зависимость К от межэлектродного промежутка: I = 1.5 (1), 2.8 (2), 46 кА (3); δ — от тока разряда: сплошной анод — светлые значки I - h = 0.5, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 4 мм; анод из молибденовой сетки — темные значки 5 - h = 0.5, $\delta - 4$ мм.

продуктами эрозии катода). Видно, что при одинаковых h замена сплошного анода сетчатым приводит к увеличению K, т. е. скорость движения КП в СВД с сетчатым анодом соответствует скорости, наблюдаемой в разряде со сплошным анодом, но при большем межэлектродном промежутке. Использование сетчатого анода практически не изменяло напряжения на дуге $\Delta U \leq 1$ В.

6. Наблюдаемые зависимости K = K(h) и K = K(I), по нашему мнению, имеют единую природу и могут быть объяснены исходя из хорошо известного факта замедления движения КП при увеличении давления (см., например, [12]). Действительно, ранее нами было показано, что анод является эффективным источником вторичных атомов, образующихся под действием потока быстрых ионов из КП [13,14]. Концентрация вторичных атомов вблизи поверхности анода может в несколько раз превышать концентрацию первичной (образованной катодными струями) плазмы, так как скорость атомов $\approx 10^5$ см/с, а катодных ионов $\ge 10^6$ см/с, и достигать при токах в несколько кА величины $N_a \ge 10^{16}$ см⁻³. По мере проникновения в межэлектродный промежуток эти атомы ионизуются, образуя вторичную плазму [15]. Уменьшение *b* приводит к повышению концентрации вторичных частиц у поверхности катода и соответственно к снижению скорости движения КП. С ростом плотности тока растет импульс, передаваемый от катодных струй к вторичным частицам, поток вторичных частиц как бы прижимается к аноду [16]. Этим, по-видимому, можно объяснить увеличение *K* с ростом тока при фиксированном *h*.

Предложенное объяснение наблюдаемых зависимостей является сугубо качественным. Подтвердить его расчетом трудно, хотя бы потому, что в настоящее время не существует последовательной общепринятой теории, описывающей сам феномен ретроградного движения и влияние давления на его скорость. Поэтому представляют интерес эксперименты с сетчатым анодом. Полученные результаты (рис. 2, δ) находят удовлетворительное объяснение в рамках предложенной модели. Действительно, использование сетки уменьшило поверхность анода, взаимодействующую с катодной струей, сквозь сетку вторичная плазма могла вытекать за пределы межэлектродного промежутка, давление вблизи катода уменьшилось соответственно тому, что получается в разряде со сплошным анодом при большем h (ср. 1 и 5, 4 и 6 на рис. 2, δ).

Работа выполнена при частичной поддержке Международного научного фонда и Российского правительства (грант № R5D000 R5D300) и Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 93-02-17416).

Список литературы

- Kaneko E., Chshima I. // Proc. XV ISDEIV. 1992. Darmstadt (Germany). P. 747–755.
- [2] Плютто А.М., Рыжов В.Н., Капин А.Г. // ЖЭТФ. 1964.
 Т. 47. Вып. 2. С. 494–507.
- [3] Афанасьев В.П., Дюжев Г.А., Школьник С.М. // ЖТФ. 1992. Т. 62. Вып. 11. С. 80–82. Там же. 1993. Т. 63. Вып. 3. С. 34–50.
- [4] Перский Н.Е., Сысун В.И., Хромой Ю.Д. // ТВТ. 1989.
 Т. 27. Вып. 6. С. 1060–1067.
- [5] Логачев А.А., Чалый А.М., Школьник С.М. // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22. Вып. 11. С. 26–30.
- [6] Sherman J.C., Webster R., Jenkins J.E., Holmes R.J. // Phys. D. 1975. Vol. 8. N 6. P. 696–702.
- [7] Мицкевич М.К., Бушик А.И., Бакуто И.А. и др.
 Электроэрозионная обработка металлов / Под ред.
 И.Г.Некрашевича. Минск: Наука и техника, 1988. 216 с.
- [8] Fang D.Y. // J. Phys. D. 1982. Vol. 15. P. 835-844.
- [9] Fu Y.H. // Thesisis. Tech. Univ. Eindhoven (Nethterlands), 1990. P. 22–42.
- [10] Gundlach H.C.W. // V ISDEIV. Poznan, 1972. P. 243–252.
- [11] Chaly A.M., Logatchev A.A., Shkol'nik S.M. // XVI ISDEIV.
 Proc. SPIE 2259. 1994. P. 105–108.
- [12] Galagher C.J. // J. Appl. Phys. 1950. Vol. 21. N 7. P. 768-771.
- [13] Логачев А.А., Митрофанов Н.К., Циркель Б.И., Школьник С.М. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. Вып. 9. С. 78–82.
- [14] Логачев А.А., Школьник С.М. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 4. С. 75–78.
- [15] Logatchev A.A., Shkol'nik S.M. // Proc. 17th ICEC. Nagoya (Japan), 1994. P. 907–914.
- [16] Boxman R.L., Goldsmith S. // IEEE Trans. Plas. Sci. 1990. Vol. 18. N 2. P. 231-236.